

(19) Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
Oficina internacional



(43) Fecha de publicación internacional
21 de Abril de 2005 (21.04.2005)

PCT

(10) Número de Publicación Internacional
WO 2005/036098 A1

(51) Clasificación Internacional de Patentes²: G01B 11/12,
11/25, G01N 21/954

(21) Número de la solicitud internacional:
PCT/ES2004/000436

(22) Fecha de presentación internacional:
8 de Octubre de 2004 (08.10.2004)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(30) Datos relativos a la prioridad:
P200302355 10 de Octubre de 2003 (10.10.2003) ES

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US):
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
[ES/ES]; Jordi Girona Salgado, 31. Edif. C-H, E-8034
Barcelona (ES).

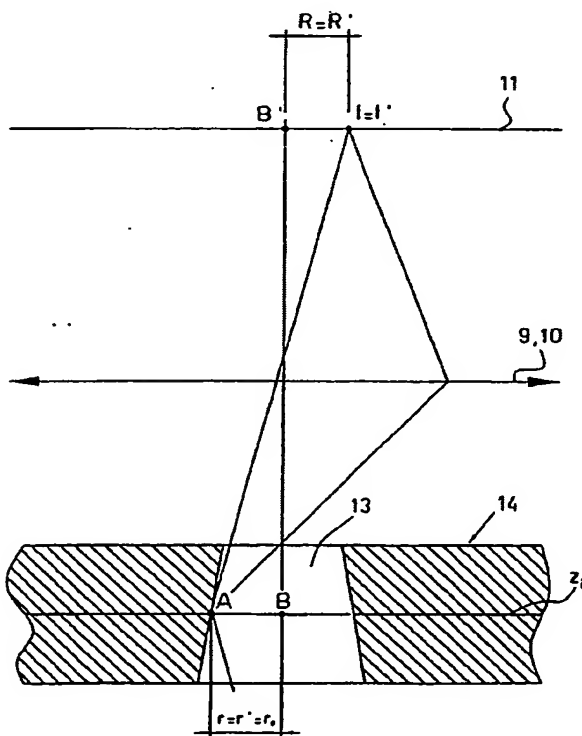
(72) Inventores; e

(75) Inventores/Solicitantes (para US solamente):
LAGUARTA BERTRAN, Ferran [ES/ES]; Jordi
Girona Salgado, 31, Edificio C-H, E-08034 Barcelona
(ES). ARTIGAS PURSALS, Roger [ES/ES]; Jordi
Girona Salgado, 31, Edificio C-H, E-08034 Barcelona
(ES). CADEVALL ARTIGUES, Cristina [ES/ES]; Jordi
Girona Salgado, 31, Edificio C-H, E-08034 Barcelona
(ES).

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: OPTICAL METROLOGY METHOD WHICH IS USED TO DETERMINE THE THREE-DIMENSIONAL TOPOGRAPHY OF A HOLE

(54) Título: PROCEDIMIENTO DE METROLOGÍA ÓPTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL DE UN ORIFICIO



(57) Abstract: The invention relates to a method for the optical metrology of conical holes. The inventive method consists in: placing the body comprising the hole in a microscope such that the larger-diametered area of the hole is directed towards lighting means, centring the hole in the field of vision of the observation means, focusing on the smaller-diametered area with the aid of an intense light, and measuring the diameter thereof and the main defects in same. The focusing plane is then changed and the contour of the hole is measured by projecting a series of patterns and measuring the position of points along the contour when the images of the projected pattern and the reflection thereof inside the hole are superimposed in the plane of a camera belonging to the equipment. The method is repeated and the information relating to the contours measured in different planes is processed in order to obtain a three-dimensional geometric representation and the characteristic parameters of the topography of the interior of the hole.

(57) Resumen: Un procedimiento de metrología óptica de orificios cónicos según la invención consiste en disponer el cuerpo con el orificio en un microscopio con la zona de mayor diámetro orientada hacia unos medios de iluminación centrándolo en el campo de visión de unos medios de observación y enfocar mediante iluminación extensa sobre la zona de menor diámetro midiendo su diámetro y defectos mayores. Después se cambia el plano de enfoque y se mide el contorno del orificio proyectando series de patrones midiendo la posición de los puntos del contorno del orificio cuando se superponen en el plano de una cámara del equipo las imágenes del

[Continúa en la página siguiente]

WO 2005/036098 A1